

定制聚四氟乙烯晶圆承载架 耐腐蚀耐高温 半导体多晶硅加工支架

货号: PL-CP287



简介

专为极端化学环境和高温半导体工艺设计的优质定制聚四氟乙烯晶圆支架。这些耐腐蚀载体确保了在关键的多晶硅、光伏和先进电子制造工艺流程中的高纯度处理、低摩擦操作和卓越的耐用性。

[了解更多](#)

应用领域	描述	主要优势
硅片蚀刻	在浸入强腐蚀性氢氟酸和硝酸混合物时安全固定硅片。	卓越的耐酸性和零污染。
RCA清洗工艺	在涉及氨水和过氧化氢的多步骤清洗序列中用作载体。	抵抗强氧化剂的降解。
太阳能电池生产	在太阳能行业的掺杂和表面织构化过程中支撑光伏基板。	高热稳定性和化学惰性。
多晶硅锭处理	在提纯和分析过程中管理高纯度多晶硅块的放置。	防止金属离子浸出和表面接触损伤。
痕量分析实验室器皿	作为分析化学中高纯度样品存储和运输的专用支架。	确保最高水平的样品完整性和纯度。
半导体湿法工作台	集成到自动化湿法处理系统中，用于大批量基板清洗和漂洗。	低摩擦便于顺畅的自动化处理。
电镀夹具	在精密电沉积过程中充当非导电、耐化学腐蚀的支撑物。	电绝缘性与化学稳定性相结合。

参数	规格详情
产品标识	PL-CP287
基材	高纯度聚四氟乙烯
制造工艺	精密数控加工 / 定制制造
定制可用性	完全根据用户规格定制
温度范围	-200°C 至 +260°C
化学兼容性	通用（对大多数酸、碱和溶剂呈惰性）
表面处理	高光滑度、不粘、疏水
槽口配置	宽度、深度和间距可定制
负载能力	根据基板密度和数量定制
污染控制	无金属、无添加剂结构
尺寸	根据客户要求定制设计